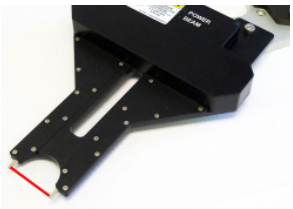
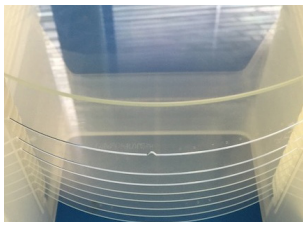
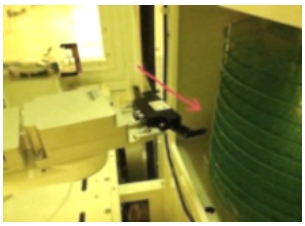
对射型-晶圆扫描及位置传感器



本公司对射型-晶圆扫描(Thrughbeam mapping sensor) 提供低成本可靠的晶圆扫描，可检测晶圆在插槽中的位置错误。

适用于不同尺寸、材料和涂层的晶圆。可用于检测低反射率、透明和薄、弯曲的晶圆，满足小间距的使用要求。亦可用于因为晶圆由于搬运造成初始位置改变时（小于3mm）的场所。位置传感器 (Presence sensor) 提供监控晶片的存在，以加強晶圆传送安全。



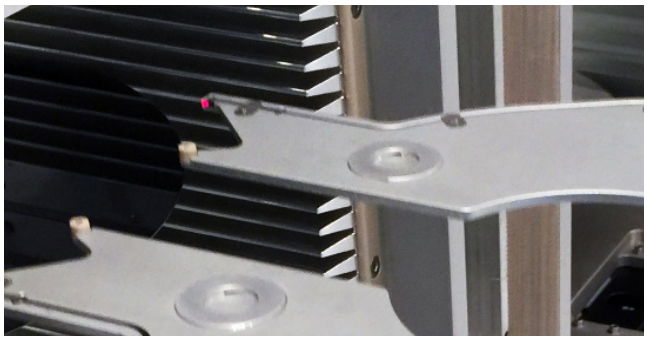


不限晶圆尺寸、厚度、弯曲和材料

可用于检测低反射率、透明和薄、弯曲的晶圆，硅、蓝宝石、玻璃和复合片

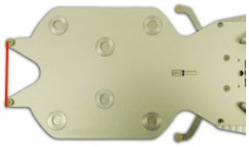
我们的传感器可以单独出售，也可以集成到边缘夹持器或真空夹持器(Endeffctor)中出售，满足小空间的使用要求(Small footprint)。

* Accurately detects empty slots and cross slotted or double slotted wafers
准确检测空槽、交叉槽或双槽中的晶圆
* Requires minimal wafer engagement < 3mm from wafer edge
最小晶圆占用范围（从晶圆边缘起< 3mm)
* Class one laser
等级1 激光
* Immune to ambient light
不受环境光影响
* Any wafer size, thickness, warpage or substrate material
不限晶圆尺寸、厚度、弯曲和材料
* Available for a variety of applications (e.g. integrated in end effectors)
多种应用（可集成到末端执行器）
* Bridge applications for 125-150mm, 150-200mm, and 200-300mm.
测量范围：125-150mm, 150-200mm, and 200-300mm.



对射式扫描传感器

50-0012 扫描传感器，对射，50 mm
50-0014 扫描传感器，对射，100 mm
50-0015 扫描传感器，对射，125mm - 150mm
50-0016 扫描传感器，对射，150mm - 200mm
50-0017 扫描传感器，对射，300mm



带前段扫描功能的涡流边缘夹持器

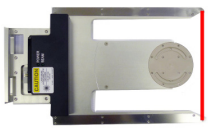
涡流边缘夹持器，U型，带前端对射光学传感器

带前段扫描功能的边缘夹持器

边缘夹持器，自动对心，“铲”型，前段对射光学传感器

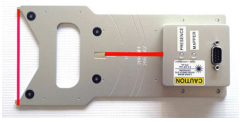
带侧面扫描功能的边缘夹持器

边缘夹持器，自动对心，“铲”型，侧面对射光学传感器



带前段扫描功能的真空末端夹持器

真空末端夹持器，采用对射光学传感器



带前段扫描传感器和位置传感器的重力末端执行器

重力夹持末端执行器采用前段光学扫描传感器和位置传感器

基本参数

晶圆尺寸	50mm, 100mm, 125-150mm, 150-200mm和200-300mm	功率	0.3mW
		波长	680nm
晶圆材料	薄、厚或弯曲 硅、蓝宝石、玻璃和复合片	偏差	~1.5°
		安全	Class 1A
光学调制频率	7kHz	电源	24 V DC, 45mA

QUARTET MECHANICS INC.
email: inquiry@quartetmechanics.com / www.quartetmechanics.com
4055 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA
P +1.510.490.1886 / F +1.510.490.1887
亚洲地区请洽询 周先生 +86.173.0165.2253／Email: nchou@quartetmechanics.com

Quartet MECHANICS

Copy right ® 2010-2016 Quartet Mechanics. All rights reserved.Rev 2016/06